

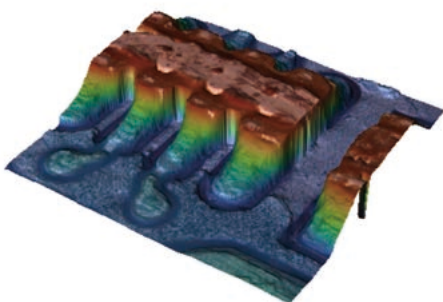
表面解析を新次元へ。

信頼の測定技術で、あらゆる表面を解析

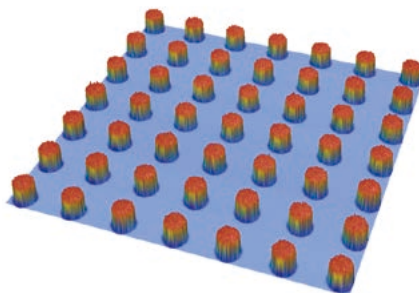
白色干渉計搭載 3D 測定レーザー顕微鏡

LEXT OLS5500

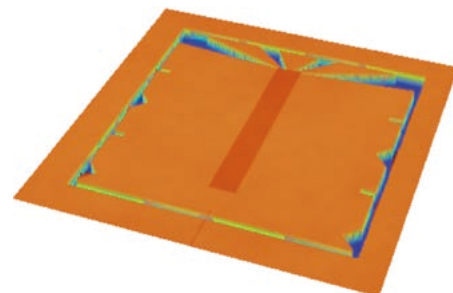
◀ 3-in-1 Hybrid system ▶



フォーカスバリエーション



レーザー顕微鏡



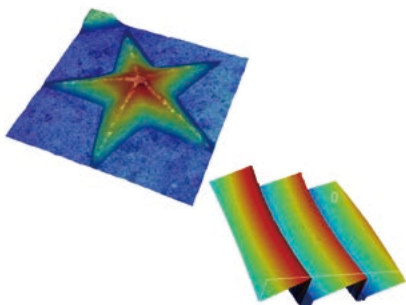
白色干渉計

レーザー顕微鏡(LSM)、白色干渉計(WLI)、フォーカスバリエーション(FVM)の高精度な測定性能、スマートな自動化機能、直感的な操作性により、あらゆる用途で自信を持ってご使用いただけます。

Key Values

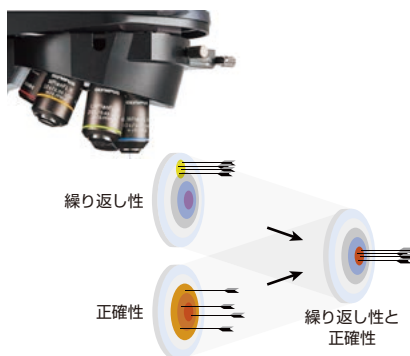
1 比類なき イメージングソリューション

- nmからmmまで1台で対応できる
シームレスな3-in-1ソリューション
- 自社開発・設計の光学系による
高い光学性能
- 微細な構造から透明なものまで
見えないものを可視化



2 揺るぎない測定品質

- 測定環境下における
測定精度保証*
* レーザー顕微鏡はISO/IEC17025 認定校正が可能
- 世界初* LSMとWLIダブルでの
高さ測定ノイズ保証
* 2025年10月、当社調べによる



3 誰でもすぐにスマートに測定

- シームレスな操作フローにより
誰でも直感的に操作可能
- マクロや解析テンプレートによる
測定の自動化



ステージを動かして
ピントがずれても

すぐに
自動で追従



さらに動かして
ピントがずれても

またすぐに
自動で追従

OLS5500 製品仕様

標準仕様

型 式		OLS5500-SAF	OLS5500-EAF	OLS5500-LAF
総合倍率		54× - 17,280×		
視野サイズ		16μm - 5120μm		
測定原理	検鏡方式	反射型共焦点レーザー顕微鏡画像、反射型共焦点レーザー微分干渉顕微鏡画像 フォーカスバリエーション検鏡法、カラー画像、カラー微分干渉画像 (ポラライザ、アナライザユニットは本体に内蔵)		
		白色干渉法	-	
レーザー顕微鏡	高さ測定	光検出器	レーザー：光電子増倍管 (2系統)、カラー：CMOSカメラ	
		繰返し性 $\sigma n-1^{*1*2*5}$	5×：0.45μm, 10×：0.1μm, 20×：0.03μm, 50×：0.012μm, 100×：0.012μm	
	幅測定	正確さ ^{*1*3*5}	0.15 + L/100μm (L：測定長[μm])	
		高さ測定ノイズ ^{*1*4*5}	1nm [Typ]	
繰返し性 $3\sigma n-1^{*1*2*5}$		5×：0.4μm, 10×：0.2μm, 20×：0.05μm, 50×：0.04μm, 100×：0.02μm		
正確さ ^{*1*3*5}		測定値±1.5%		
最大取得データ解像度		4096×4096ピクセル		
最大貼り合わせ画素数		400百万ピクセル		
XYステージ	駆動範囲	100×100mm(電動)		300×300mm(電動)
	耐荷重	3kg		5kg
サンプル最大高さ		100mm	210mm	37mm
レーザー光源	波長	405nm		
	最大出力	0.95 mW		
	レーザークラス	Class 2 (JIS C 6802 : 2018, IEC60825-1 : 2014, EN60825-1 : 2014/A11 : 2021, GB/T 7247.1-2024)		
カラー光源		白色LED		
消費電力		240 W		278 W
質量	顕微鏡本体	約31kg	約43kg	約50kg
	コントロールボックス	約12 kg		

白色干渉計仕様

白色干渉計	高さ測定	繰返し性 $\sigma n-1^{*1*5}$	0.3%
		正確さ ^{*6}	1% [Typ]
		Surface topography repeatability ^{*5*7}	0.08nm
		Repeatability of RMS ^{*8}	<0.008nm
	サンプル最大高さ	68mm	
耐荷重(傾斜ステージ搭載時)		1.8kg	

対物レンズ仕様

	型式	NA	作動距離 (mm)
観察用レンズ	MPLFLN2.5X	0.08	10.7
	MPLFLN5X	0.15	20
	LMPLFLN10X	0.25	21
LEXT専用レンズ(10x)	MPLFLN10XLEXT	0.3	10.4
LEXT専用レンズ (高性能タイプ)	MPLAPON20XLEXT	0.6	1.0
	MPLAPON50XLEXT	0.95	0.35
	MPLAPON100XLEXT	0.95	0.35
LEXT専用レンズ (長作動距離タイプ)	LMPLFLN20XLEXT	0.45	6.5
	LMPLFLN50XLEXT	0.6	5.2
	LMPLFLN100XLEXT	0.8	3.4

	型式	NA	作動距離 (mm)
超長作動距離レンズ	SLMPLN20X	0.25	25
	SLMPLN50X	0.35	18
	SLMPLN100X	0.6	7.6
液晶用長作動距離レンズ	LCPLFLN20XLCD	0.45	8.3-7.4
	LCPLFLN50XLCD	0.7	3.0-2.2
	LCPLFLN100XLCD	0.85	1.2-0.9
白色干渉対物レンズ	WLI10XMRTC	0.3	8.2
	WLI20XMRTC	0.6	1.0
	WLI50XMRTC	0.8	1.0

*1:ISO554(1976)、JIS Z-8703(1983)に規定されている恒温・定湿度環境(温度:20℃±1℃、湿度:50%±10%)で使用する場合に保証される。 *2:20x以上の場合、MPLAPON LEXT シリーズレンズで測定した場合。 *3:LEXT専用レンズで測定した場合。 *4:MPLAPON100XLEXTの対物レンズで測定した場合の標準値で、保証値とは異なる。 *5:当社の保証方法による。
*6:当社が規定した条件下で国家規格にトレーサブルな標準段差サンプル(83nm)を使用して測定した代表値であり、保証値とは異なる。保証値は0.15 + L/100μmです。
*7:高さ測定ノイズと同義 *8:当社指定条件下での測定による。

EvidentScientific.com

株式会社エビデント

〒192-0033 東京都八王子市高倉町67-4

EVIDENT Customer Information Center

お客様相談センター 受付時間 平日 9:00 ~ 17:00

0120-58-0414 ※フリーダイヤルがご利用できない場合 03-6901-4200

お問い合わせ: <https://evidentscientific.com/ja/contact-us/>

- 当社は環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。登録範囲は <https://evidentscientific.com/ja/legal/iso/> をご覧ください。
- 当社は品質マネジメントシステムISO9001の認証取得企業です。
- 安全にお使いいただくために：顕微鏡用照明装置には耐用年がありますので、定期点検をお願い致します。詳細は当社HPをご覧ください。
- このカタログに記載の社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
- モニタ画像ははめ込み合成です。
- 仕様・外観については、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

取扱販売店名



機器の販売から設置、保守・修理までトータルサポート

株式会社 大熊

<https://k-okuma.co.jp/>

EVIDENT